

## ナノプロセッシング施設（NPF）装置一覧

2024年4月1日現在

No.	装置番号	施設等名称	備考	
1	NPF001	電子ビーム描画装置（CRESTEC）	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
2	NPF003	イオンコーター（FIB 付帯）（2F）	2F 一般実験室	観察・計測・分析
3	NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800_FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
4	NPF005	低真空走査電子顕微鏡	2F 一般実験室	観察・計測・分析
5	NPF006	マスクレス露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
6	NPF008	スピンコーター（フォト）	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
7	NPF009	コンタクトマスクアライナー[MJB4]	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
8	NPF010	反転露光用全面 UV 照射装置	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
9	NPF011	i 線露光装置	CR3 イエロールーム	リソグラフィー
10	NPF012	有機ドラフトチャンバー_右（フォト）	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
11	NPF013	有機ドラフトチャンバー_左（フォト）	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
12	NPF014	有機ドラフトチャンバー_右（EB）	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
13	NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー_1	CR1 クリーンルーム	表面処理
14	NPF016	スターラーウォーターバス[SWB-10L-1]	CR1 クリーンルーム	表面処理
15	NPF017	スマートウォーターバス[TB-1N]（フォト）	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
16	NPF018	反応性イオンエッチング装置（RIE）	CR5 クリーンルーム	エッチング
17	NPF019	多目的エッチング装置（ICP-RIE）	CR5 クリーンルーム	エッチング
18	NPF021	プラズマアッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理
19	NPF022	UV オゾンクリーナー	CR1 クリーンルーム	表面処理
20	NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜
21	NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜
22	NPF025	スパッタ成膜装置（芝浦）	CR1 クリーンルーム	成膜
23	NPF029	メッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜
24	NPF030	プラズマ CVD 薄膜堆積装置	CR5 クリーンルーム	成膜
25	NPF031	原子層堆積装置_1[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜
26	NPF032	クロスセクションポリッシャー（ALD 付帯）	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
27	NPF033	アルゴンミリング装置	CR1 クリーンルーム	エッチング
28	NPF034	集束イオンビーム加工観察装置（FIB）	2F 一般実験室	観察・計測・分析
29	NPF035	イオンコーター（SEM 付帯）（2F）	2F 一般実験室	観察・計測・分析
30	NPF038	二次イオン質量分析装置（D-SIMS）	2F 一般実験室	観察・計測・分析
31	NPF039	オゾンクリーナー（SIMS 付属）	2F 一般実験室	観察・計測・分析
32	NPF041	ウェハー酸化炉	CR1 クリーンルーム	熱処理
33	NPF042	クリーンオープン	CR1 イエロールーム	熱処理
34	NPF044	マップル炉	CR1 クリーンルーム	熱処理
35	NPF045	触針式段差計	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析

36	NPF046	走査プローブ顕微鏡 SPM_1 [NanoscopeIV/Dimension3100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
37	NPF047	走査プローブ顕微鏡 SPM_2[SPM-9600/9700]	2F 一般実験室	観察・計測・分析
38	NPF048	ナノサーチ顕微鏡 SPM_3[SFT-3500]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
39	NPF049	ナノプローバー[N-6000SS]	2F 一般実験室	観察・計測・分析
40	NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
41	NPF051	デバイスパラメータ評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
42	NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
43	NPF053	ワイヤーボンダー (2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
44	NPF054	ダイシングソー	CR4 クリーンルーム	その他
45	NPF055	スクライバー	CR4 クリーンルーム	その他
46	NPF056	研磨機	CR1 クリーンルーム	その他
47	NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
48	NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
49	NPF063	分光エリプソメータ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
50	NPF064	解析用 PC (分光エリプソメータ用)	2F データ解析室	観察・計測・分析
51	NPF065	顕微レーザーラマン分光装置 (RAMAN)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
52	NPF066	顕微フーリエ変換赤外分光装置 (FT-IR)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
53	NPF067	解析用 PC (CAD 及びSPM, FT-IR, Raman 用)	2F データ解析室	観察・計測・分析
54	NPF068	磁気特性測定システム (MPMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
55	NPF070	X 線回折装置 (XRD)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
56	NPF072	微小部蛍光 X 線分析装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
57	NPF073	解析用 PC (CAD 及びX 線用)	2F データ解析室	観察・計測・分析
58	NPF074	X 線光電子分光分析装置 (XPS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
59	NPF075	解析用 PC (XPS 用)	2F データ解析室	観察・計測・分析
60	NPF081	プラズマ CVD 薄膜堆積装置 (SiN)	CR5 クリーンルーム	成膜
61	NPF082	化合物半導体エッチング装置 (ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング
62	NPF084	デジタルマイクロスコープ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
63	NPF085	物理特性測定装置 (PPMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
64	NPF086	マニュアルウェハープローバー (2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
65	NPF088	電界放出形走査電子顕微鏡 [S4500/FE-SEM] (2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析

No.	装置番号	施設等名称	備考	
66	NPF089	赤外線ランプ加熱炉 (RTA)	CR1 クリーンルーム	熱処理
67	NPF091	自動塗布現像装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
78	NPF092	高圧ジェットリフトオフ装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
69	NPF093	高速電子ビーム描画装置 (エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
70	NPF094	解析用 PC (CAD 及び近接効果補正用)	2F データ解析室	リソグラフィー
71	NPF095	RF-DC スパッタ成膜装置 (芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜
72	NPF096	単波長エリプソメータ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
73	NPF098	ECR スパッタ成膜・ミリング装置	CR1 クリーンルーム	成膜
74	NPF099	サムコ原子層堆積装置_2[AD-100LP]	CR5 クリーンルーム	成膜
75	NPF100	解析用 PC (L-Edit レイアウト・エディタ)	2F データ解析室	その他
76	NPF101	Si 深掘エッチング装置[PlasmaPro_100]	CR5 クリーンルーム	エッチング
77	NPF102	原子層堆積装置_3[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜
78	NPF103	原子層堆積装置_3 付帯XPS 装置 (アルバック・ファイ)	CR5 クリーンルーム	成膜
79	NPF104	原子層堆積装置_4[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜
80	NPF105	ピュアオゾン供給装置	CR5 クリーンルーム	成膜
81	NPF106	小型自動現像装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
82	NPF107	3次元電界放出形走査電子顕微鏡 (エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
83	NPF108	イオンコーター (エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
84	NPF109	6インチ電子ビーム真空蒸着装置 (アールデック)	CR1 クリーンルーム	成膜
85	NPF110	レーザー描画装置[DWL66+]	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
86	NPF111	酸アルカリドラフトチャンバー_2	CR1 クリーンルーム	表面処理
87	NPF112	有機ドラフトチャンバー_左 (EB)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
88	NPF113	スピンコーター (EB)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
89	NPF114	平行平板型プラズマアッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理
90	NPF115	大面積電子ビーム描画装置[UHSEB]	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
91	NPF116	EB用自動現像装置 (カナメックス)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
92	NPF117	多機能型薄膜X線回折装置(XRD)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
93	NPF118	多機能型光電子分光分析装置(XPS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
94	NPF119	マスクレス露光装置[MLA150]	CR2 クリーンルーム	リソグラフィー